

深紫外激光调制反射光谱仪

Deep-Ultraviolet Photoreflectance Spectrograph

DUV-PR



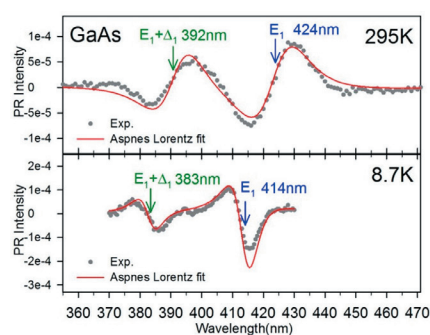
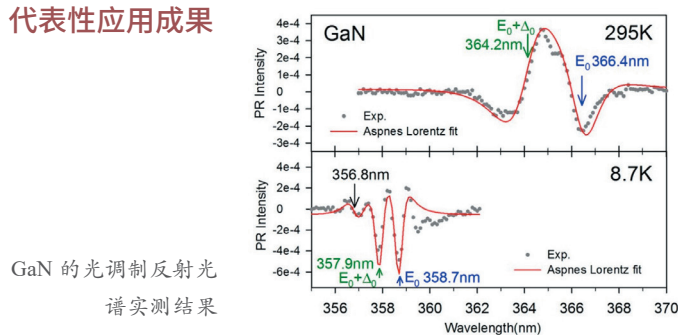
主要技术与性能指标

- 激发光源: 177.34 nm
- 光谱扫描范围: 180—1 100 nm
- 光谱分辨率: 优于 0.06 nm
- 控温范围: 10—300 K
- 真空度: 2.5×10^{-6} Torr
- 调制反射比: 优于 10^{-4}

主要应用

半导体材料能带结构表征等

代表性应用成果



| | |
|--------|--|
| 主要用户单位 | 中国科学院半导体研究所 |
| 研制单位 | 中国科学院半导体研究所 |
| 联系方式 | 谭平恒 010-82304247, 18511076486 phtan@semi.ac.cn |